

# 電子ビームリソグラフィ実践セミナーⅣ

筑波大学、物質・材料研究機構、東京工業大学、産業技術総合研究所は、文部科学省委託事業である「ナノテクノロジープラットフォーム」の一環として「電子ビームリソグラフィ実践セミナーⅣ」を筑波大学東京キャンパスにて開催いたします。電子ビーム露光の基礎から最新のレジストプロセスまで、露光事例とともに微細パターン形成技術について紹介いたします。また、各セッションの終わりにオーサーズ・インタビューの時間を設けました。普段質問しづらいことを、この機会に是非、講師の先生方に個別にご質問ください。また、このセミナーへの参加をより充実した機会にするために、実習コースを併設しています。産学官にかかわらず、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

## ◇講演

【日時】平成30年10月26日（金）12:55～16:00

【場所】筑波大学東京キャンパス文京校舎 120号教室（丸ノ内線茗荷谷駅）

[http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo\\_access.html](http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html)

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h30-2/index.html>

## 【講演プログラム】

- |             |                            |                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| 12:55-13:00 | はじめに                       | 産業技術総合研究所 多田哲也                   |
| 13:00-13:30 | 『デバイス・プロセスを見込んだ電子ビーム露光』    | 東京工業大学 宮本恭幸                      |
| 13:30-13:50 | 『電子ビーム露光における近接効果補正』        | 産業技術総合研究所 有本 宏                   |
| 13:50-14:20 | 『電子ビーム描画における露光データの最適化处理』   | GenISys株式会社 清水 諭                 |
| 14:20-14:40 | 休憩（オーサーズインタビュー）            |                                  |
| 14:40-15:10 | 『電子ビーム描画装置の応用的な使い方について』    | 株式会社エリオニクス 新関 嵩                  |
| 15:10-15:40 | 『電子ビーム露光によるレジスト材料評価事例のご紹介』 | 富士フイルム株式会社エレクトロニクスマテリアルズ研究所 土橋 徹 |
| 15:40-16:00 | 『現像プロセスにおける温度管理の有意性』       | 物質・材料研究機構 津谷大樹                   |
| 16:00～17:30 | 意見交換会（無料）                  |                                  |

## ◇実習コース

物質・材料研究機構 NIMS微細加工プラットフォーム ELS-7000改（エリオニクス）

12月5日（水）EB描画（基礎） 定員：3名（無料）

12月19日（水）EB描画（応用） 定員：3名（無料）

下記URLに記載されている申し込みに従って直接お申し込みください。

<http://www.nims.go.jp/rnfs/events/H30/school.html>

東京工業大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所 JEOL JBX-6300SJ（日本電子）

11月1日（木）、11月2日（金） 定員：1日2名（無料）

初心者を対象に3層レジスト露光のプロセス習得

産業技術総合研究所 ナノプロセッシング施設（NPF） ELS-F130AN（エリオニクス）

11月6日（火） 定員：3名（無料）

初心者を対象にパターン設計、描画、現像、パターン観察まで行う。

主催：産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設（NPF）

主催：物質材料研究機構微細加工プラットフォーム

主催：筑波大学微細加工プラットフォーム

主催：東京工業大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

共催：ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会（TSC）

協賛：GenISys株式会社

協賛：株式会社エリオニクス

電子メール：[tia-npf-school2@aist.go.jp](mailto:tia-npf-school2@aist.go.jp)

